

Q-NC顕微鏡講習会

今回のテーマは、

「多光子顕微鏡システムの半導体への応用」

多光子顕微鏡を使うとワイドギャップ半導体結晶の内部欠陥を非破壊・3Dで観察できます！

Nikonアプリケーションスペシャリストである担当教員が、SiCやGaNといった次世代パワー半導体向けの材料の内部に潜む欠陥や不純物分布を非破壊かつ3Dで観察できる「MPPL法」という技術紹介を行います。

今回は、Microsoft Teamsを用いたオンライン講習会となります。お申込み下さった方に、参加URLをお送りします。

名古屋大学外の一般企業の方も参加できます。

日程 : 2024年10月15日(水)

時間 : 10:00~12:00

担当 : 名古屋大学 未来社会創造機構

名古屋市量子産業創出寄附研究部門 鶴旨 篤司

連絡先 : tsurumune.atsushi.i6@f.mail.nagoya-u.ac.jp

TEL 052-558-9755

場所 : 理学部共用館 1F 201号室

次回予定 : 2024年10月16日(金) 「超解像顕微鏡システム」